(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2003-251773 (P2003-251773A)

(43)公開日 平成15年9月9日(2003.9.9)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

B 3 2 B 27/34

B 3 2 B 27/34

4F100

審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 4 頁)

(21)出願番号

特願2002-58906(P2002-58906)

(71)出願人 000219266

(22)出願日

平成14年3月5日(2002.3.5)

東レ・デュポン株式会社

東京都中央区日本橋本町一丁目1番1号

(72)発明者 前田 周

愛知県東海市新宝町31番地6 東レ・デュ

ポン株式会社東海事業場内

(74)代理人 100117938

弁理士 佐藤 謙二

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 金属積層フィルム

(57)【要約】

【課題】ポリイミドフィルムと金属を積層した積層フィルムにおいて、金属層とフイルム絶縁層の密着性を向上させた積層フィルムを提供する。

【解決手段】非熱可塑性ポリイミドフィルムの片面または両面に熱可塑性ポリイミドワニスまたはポリアミド酸ワニスをコーティングした後、乾燥させてなるフィルムの片面または両面に金属層をメタライジングしてなる金属積層フィルム。

【特許請求の範囲】

【請求項1】非熱可塑性ポリイミドフィルムの片面また は両面に熱可塑性ポリイミドワニスまたはポリアミド酸 ワニスをコーティングした後、乾燥させてなるフィルム の片面または両面に金属層をメタライジングしてなる金 属積層フィルム。

【請求項2】熱可塑性ポリイミドのガラス転移温度が150℃~280℃である請求項1記載の金属積層フィルム。

【請求項3】熱可塑性ポリイミドの乾燥後の厚みが0. 4~5μmである請求項1または2記載の金属積層フィルム。

【請求項4】メタライジングによる金属層の厚みが1~500nmである請求項1~3いずれか記載の金属積層フィルム。

【請求項5】請求項1~4いずれか記載の金属積層フィルム表面に銅メッキしてなる金属積層フィルム。

【請求項6】銅メッキ層の厚みが1~40μmである請求項5記載の金属積層フィルム。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はフレキシブルプリント配線板として使用でき、金属と絶縁層との密着性に優れた金属積層フィルムに関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来から接着剤としてエポキシ系、アクリル系、ポリアミド系、フェノール系等を使用した、ポリイミドフィルム/接着剤/金属箔の3層構造のフレキシブルプリント配線板がよく知られているが、耐熱性が接着剤の特性によって決まってしまい、接着強度に問題がある場合が多かった。また、耐熱性を向上させる接着剤として熱可塑性ポリイミドの前駆体を用い、金属箔を高温で熱圧着させる例として特開平4-146690号公報や特開2000-167980号公報等が知られているが、金属箔を高温で熱圧着しなければならないため加工後に残留歪みの問題が生じたり、圧着に用いる金属箔の厚さが通常10μm以上であるのでピッチの狭いパターニングが困難であるという欠点があった。

【0003】また、非熱可塑性ポリイミドに直接金属を メタライジングしてなる2層構造のフレキシブルプリン ト配線板も知られているが、密着性が低く特に熱負荷後 の密着性の低下が大きいという欠点がある。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は上記の 従来技術の欠点を解消し、ポリイミドフィルムと金属を 積層した積層フィルムにおいて、金属層とフイルム絶縁 層の密着性を向上させた積層フィルムを提供することに ある。

[0005]

【課題を解決するための手段】前記課題を解決すべく、

本発明者らは検討を行った結果、非熱可塑性ポリイミドフィルムの片面または両面に熱可塑性ポリイミドワニスまたはポリアミド酸ワニスをコーティングした後乾燥させてなるフィルムの、片面または両面に金属層をメタライジングしてなる金属積層フィルムが密着性向上に効果があり、また前記金属積層フィルムに銅メッキしてなる金属積層フィルムが密着性向上に効果があることを見出し、本発明に至った。

[0006]

【発明の実施の形態】本発明において、非熱可塑性ポリイミドとは、熱をかけることにより、さらに硬化が進むものではないが、熱で軟化する性質も有していないポリイミドのことを称し、例えば、ピロメリット酸二無水物、4,4'ージアミノジフェニルエーテルから得られるポリアミド酸を脱水硬化させたポリイミド等が挙げられる

【0007】非熱可塑性ポリイミドの具体例としては、 商品名「カプトン」(東レ・デュポン社製、デュポン社 製)の非熱可塑性ポリイミドシリーズ、商品名「ユーピ レックス」(宇部興産社製)の非熱可塑性ポリイミドシ リーズ、商品名「アピカル」(鐘淵化学社製)の 非熱 可塑性ポリイミドシリーズなどがあげられる。

【0008】熱可塑性ポリイミドとは、熱をかけることで可塑性を生じるポリイミドのことを称し、生成イミド基の繰り返し単位中での濃度を低下させる事で分子間の 凝集力を低減させたものなどがあげられる。

【0009】熱可塑性ポリイミドワニスまたはポリアミド酸ワニスの具体例としては、商品名「ユピタイトUPA-N111」(宇部興産社製)、商品名「ユピタイトUPA-N221」(宇部興産社製)などがあげられる。熱可塑性ポリイミドワニスまたはポリアミド酸ワニスの塗布量は乾燥後のコーティング厚が $0.4\mu m\sim5\mu m$ となるように塗布するのが好ましく、更に好ましくは $0.5\mu m\sim1.0\mu m$ となるように塗布するのが好ましく、も燥温度は $100 \sim 300 \sim 60$ 範囲が好ましく、乾燥時間は $100 \sim 300 \sim 60$ 範囲が好ましく、乾燥時間は $100 \sim 100 \sim 60$ で、100 で 100 で 10

【0010】本発明で言うメタライジングとは、金属の蒸気をフィルムの表面に付着させることやスパッタリングを言い、金属メッキ、金属箔の積層などとは区別されるものである。メタライジングの具体的方法にはスパッタリング、真空蒸着、イオンビーム蒸着、電子線蒸着などがあるが、加工の安定性、プロセスの簡素化、カールの発生が少ないこと、膜の均一性などを考えるとスパッタリング法が好ましい。メタライジングに用いられる金属は銅、ニッケル、クロム、マンガン、アルミニウム、鉄、モリブデン、コバルト、タングステン、バナジウム、チタン、タンタル等から1種類以上が選ばれる。メタライジングにより形成される金属薄膜の厚さは1~5

00nmが好ましく、5nm~200nmの範囲がより 好ましい。

【0011】メタライジングを行った後には、電解メッキまたは無電解メッキにより銅メッキ層が形成される。 銅メッキ層の膜厚は 1μ m~ 40μ mの範囲が好ましい。銅メッキ層の膜厚が 1μ m未満では配線が形成された場合の配線抵抗が大きくなる等の問題が生じ好ましくなく、 40μ mを越えると高密度配線のピッチ幅の精度が低下する等の問題が生じ好ましくない。

[0012]

【実施例】以下に本発明の実施例を示す。ただし、本発明は以下の実施例に何ら限定されるものではない。

【0013】本実施例における測定は次の方法にしたがった。

<フィルムの厚み測定>

SEMの断面写真より測定した。

<金属層の接着性測定:ピール試験>;金属積層フィルム を10mm幅、100mm長に切り出して引っ張り速度 50mm/minの条件で90度ピール試験を行った。 [実施例1] 非熱可塑性ポリイミドフィルムである厚さ 25μmの「カプトン100EN」(商品名、東レ・デ ュポン製)の片面に、熱可塑性ポリイミドワニスである 「ユピタイトUPA-N111C」(商品名、宇部興産 社製)をテトラヒドロフランで固形分15%になるよう に希釈した溶液を塗布し、120℃で1分、続いて18 0℃で10分乾燥を行った。コーティング部分の厚さは O. 7 μmであった。このようにして得たフィルムをス パッタリング装置(SAMCO社製PD-10型)に入 れ、液体窒素を用いて拡散ポンプを冷却しながら圧力を 1.3×10-3Paまで減圧して不純ガスを脱気し、 その後アルゴンガスを導入して0.27 Paで銅をスパ ッタリングしてフィルム表面に銅薄膜を形成した。銅薄 膜の厚みは150nmであった。この後硫酸銅水溶液に よる電解めっきを電流密度3A/dm2の条件で行い金 属積層フィルムを得た。電解めっきによる銅層の厚みは 8 μmであった。この金属積層フィルムを10 mm幅、 100mm長に切り出して引っ張り速度50mm/mi nの条件で90度ピール試験を行った。室温での測定結 果は9.1N/cm、150℃×240hrの熱負荷後 の測定結果は6.1N/cmであった。

【0014】[実施例2]厚さ25μmの「カプトン100EN」(商品名:東レ・デュボン製)フィルムの片面に、熱可塑性ポリイミドワニスである「ユピタイトUPA-N221C」(商品名:宇部興産社製)をテトラヒドロフランで固形分15%になるように希釈した溶液を塗布し、120℃で1分、続いて180℃で10分乾燥を行った。コーティング部分の厚さは0.9μmであった。このようにして得たフィルムをスパッタリング装置(SAMCO社製PD-10型)に入れ、液体窒素を用いて拡散ポンプを冷却しながら圧力を1.3×10-

3 Paまで減圧して不純ガスを脱気し、その後アルゴンガスを導入して 0.27 Paで銅をスパッタリングしてフィルム表面に銅薄膜を形成した。銅薄膜の厚みは80 nmであった。この後硫酸銅水溶液による電解めっきを電流密度3 A/dm2の条件で行い金属積層フィルムを得た。電解めっきによる銅層の厚みは10μmであった。この金属積層フィルムを10mm幅、100mm長に切り出して引っ張り速度50mm/minの条件で90度ピール試験を行った。室温での測定結果は9.8 N/cm、150℃×240 hrの熱負荷後の測定結果は6.8 N/cmであった。

【0015】 [実施例3] 厚さ25µmの「カプトン1 00EN」(商品名: 東レ・デュポン製) に、「ユピタ イトUPA-N111C」(商品名:宇部興産社製)を テトラヒドロフランで固形分15%になるように希釈し た溶液を塗布し、120℃で1分、続いて180℃で1 0分乾燥を行った。コーティング部分の厚さは0.7μ mであった。このようにして得たフィルムをスパッタリ ング装置(SAMCO社製PD-10型)に入れ、液体 窒素を用いて拡散ポンプを冷却しながら圧力を1.3× 10-3Paまで減圧して不純ガスを脱気し、その後ア ルゴンガスを導入して0.27Paで銅をスパッタリン グしてフィルム表面に銅薄膜を形成した。銅薄膜の厚み は150 n mであった。この後硫酸銅水溶液による電解 めっきを電流密度3A/dm2の条件で行い金属積層フ ィルムを得た。電解めっきによる銅層の厚みは25 µm であった。この金属積層フィルムを10mm幅、100 mm長に切り出して引っ張り速度50mm/minの条 件で90度ピール試験を行った。室温での測定結果は1 1. ON/cm、150℃×240hrの熱負荷後の測 定結果は7.1N/cmであった。

【0016】[実施例4]厚さ 25μ mの「カプトン1 OOEN」(商品名: 東レ・デュポン製) に、「ユピタ イトUPA-N111C」(商品名:宇部興産社製)を 塗布し、120℃で1分、続いて180℃で10分乾燥 を行った。コーティング部分の厚さは2.0µmであっ た。このようにして得たフィルムをスパッタリング装置 (SAMCO社製PD-10型)に入れ、液体窒素を用 いて拡散ポンプを冷却しながら圧力を1.3×10-3 Paまで減圧して不純ガスを脱気し、その後アルゴンガ スを導入して0.27Paで銅をスパッタリングしてフ ィルム表面に銅薄膜を形成した。銅薄膜の厚みは100 nmであった。この後硫酸銅水溶液による電解めっきを 電流密度3A/dm2の条件で行い金属積層フィルムを 得た。電解めっきによる銅層の厚みは35μmであっ た。この金属積層フィルムを10mm幅、100mm長 に切り出して引っ張り速度50mm/minの条件で9 0度ピール試験を行った。室温での測定結果は8. ON /cm、150℃×240hrの熱負荷後の測定結果は 6.1N/cmであった。

【0017】[比較例1]厚さ25μmの「カプトン100EN」(商品名:東レ・デュボン製)をスパッタリング装置(SAMCO社製PD-10型)に入れ、液体窒素を用いて拡散ポンプを冷却しながら圧力を1.3×10-3Paまで減圧して不純ガスを脱気し、その後アルゴンガスを導入して0.27Paで銅をスパッタリングしてフィルム表面に銅薄膜を形成した。銅薄膜の厚みは150nmであった。この後硫酸銅水溶液による電解めっきを電流密度3A/dm2の条件で行い金属積層フィルムを得た。電解めっきによる銅層の厚みは8μmであった。この金属積層フィルムを10mm幅、100mm長に切り出して引っ張り速度50mm/minの条件で90度ピール試験を行った。室温での測定結果は4.8N/cm、150℃×240hrの熱負荷後の測定結果は2.0N/cmであった。

【0018】 [比較例2] 厚さ25μmの「カプトン1 00EN」(商品名: 東レ・デュポン製) をスパッタリ ング装置(SAMCO社製PD-10型)に入れ、液体窒素を用いて拡散ポンプを冷却しながら圧力を1.33×10-3Paまで減圧して不純ガスを脱気し、その後アルゴンガスを導入して0.266Paで銅をスパッタリングしてフィルム表面に銅薄膜を形成した。銅薄膜の厚みは80nmであった。この後硫酸銅水溶液による電解めっきを電流密度3A/dm2の条件で行い金属積層フィルムを得た。電解めっきによる銅層の厚みは10μmであった。この金属積層フィルムを10mm幅、100mm長に切り出して引っ張り速度50mm/minの条件で90度ピール試験を行った。室温での測定結果は4.8N/cm、150℃×240hrの熱負荷後の測定結果は1.5N/cmであった。

[0019]

【発明の効果】以上に述べた通り、本発明によれば、金 属層と絶縁層との密着性に優れた金属積層フィルムを得 ることができる。

フロントページの続き

Fターム(参考) 4F100 AB01D AB01E AB17E AK46B

AK46C AK49A AK49B AK49C BA02 BA03 BA04 BA05 BA06 BA07 BA10A BA10B BA10C BA10E CC00B CC00C EH46B EH46C EH66D EH66E EH71E EJ86B EJ86C GB43 JA05A JB12A JB16B JB16C JL11 YY00A YY00D YY00E